

X 線光電子分光法(XPS, ESCA)

◆ XPS 測定により得られる情報

最表面から数 nm の極表面の構成元素、元素組成、結合状態、デプスプロファイル

◆ 測定対象

金属材料、電子材料、半導体材料、セラミックス、ゴム材料、プラスチック材料、塗膜、繊維等のあらゆる固体材料

◆ 特長

本機構の XPS では、一般的な XPS 測定に加え、 $10\mu\text{m}$ 径の微小部分分析や高速イメージングが可能ですので、微小試料や X 線によるダメージで元素組成が変化しやすい試料でも正確な元素分布及び結合状態を知ることができます。

◆ 応用

ポリマーの劣化構造解析

接着表面、特殊加工表面の官能基解析

電子材料、金属材料の表面汚染度評価

